

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Н. С. Иванов. Помехоустойчивая М-оценка выборок многократных наблюдений

НАНОМЕТРОЛОГИЯ

В. В. Альзоба, В. П. Гавриленко, А. Ю. Кузин, В. Б. Митюхляев, А. В. Раков, П. А. Тодуа, М. Н. Филиппов. Нелинейность развертки растрового электронного микроскопа

ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

В. Л. Минаев, Г. Н. Вишняков. Интерференционный профилометр для измерения формы поверхности отражающих объектов

ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Ю. А. Пластинин, А. В. Родионов, И. Ю. Скрыбышева. Моделирование оптико-физических явлений в верхних слоях атмосферы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Е. М. Белозубов, Н. Е. Белозубова, В. А. Васильев. Метод уменьшения температурной погрешности тонкопленочных емкостных нано- и микроэлектромеханических систем и датчиков на их основе